Swagelok

手動式レギュレーター HF シリーズ 技術情報

適用範囲

この技術情報は、Swagelok®手動式レギュレーター HF シリーズに関するデータです。以下の事項について記載しています。

- 表面仕上げ
- パーティクル・カウント
- 水分分析
- 炭化水素分析
- 残留イオン濃度
- 実験室でのサイクル・テスト

なお、パーティクル・カウント、水分分析、炭化水素分析、残留イオン濃度に関するデータは、超高純度工程仕様 (Swagelok SC-01 仕様) (MS-06-61-EJ) に基づき、超純水を用いて洗浄したレギュレーターのテスト結果です。

表面仕上げ

Swagelok SC-01 仕様に記載されているとおり、スウェージロックでは、統計的プロセス・コントロール (SPC) により、均一に表面を仕上げています。 Swagelok

SC-01 仕様の手動式レギュレーター HF シリーズの接ガス部の表面粗さは、 平均値で $0.13 \, \mu m \, (R_a)$ の仕上げとなっています。

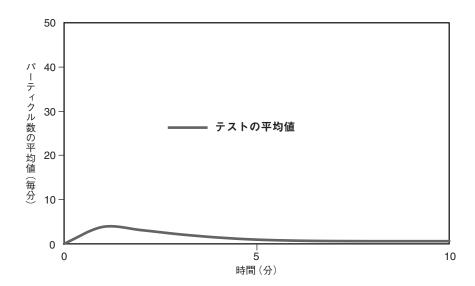
パーティクル・カウント

手動式レギュレーター HF シリーズから 検出されたスタティック (静的)・パーティ クル数は、非常に少なくなっています。

SEMASPEC 93021510A-STD に基づいて、 5 台のレギュレーター (型番: SS-HFM3B-VCR4-P) のテストを行いました。

- クラス 100 クリーンルーム
- クラス 100 層流ベンチ
- 流量:31 std L/min
- サイズが 0.014 µm を超えるパーティクルのモニターを行っています。(なお、一般的なカウンターは、サイズが0.020 µm 以上のパーティクルをモニターします。)
- レギュレーターは、全開状態にてテストを行っています。

右のデータは、5台のレギュレーターの平均値を示しています。



水分分析

SEMI E 49.8 に基づいて、独立ラボにて手動式レギュレーター HF シリーズのテストを行いました。

5台のレギュレーター(型番:SS-HFM3B-VCR4-P)は、20 分以内に 2 ppm の水分スパイクからバックグラウンド・レベルまで回復します。SEMI E 49.9 による許容時間は最大で 1 時間となっているため、これは非常に早い回復スピードです。

- テスト・ガス:高純度窒素
- 流量:1.28 std L/min (0.20 MPa にて)

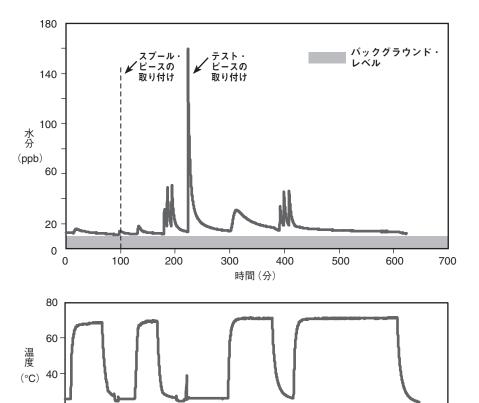
下段のグラフは、システムの水分感度を向上させるため、テスト中のレギュレーターに適用された温度上昇パターンを示しています。

右のデータは、テストした5台のレギュレーターのうちの1台の結果を示していますが、これは5台すべての典型的な結果です。

20

100

200

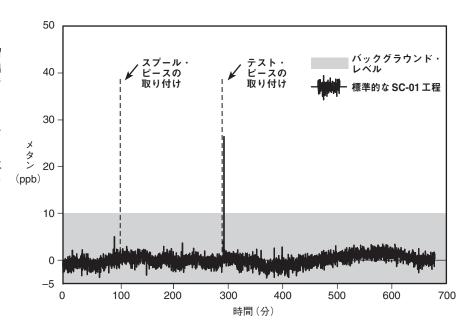


炭化水素分析

手動式レギュレーター HF シリーズの残留 炭化水素量は、テスト装置によって作り出 したバックグラウンド・レベルの範囲内で した。

レギュレーターの炭化水素分析は、 SEMASPEC 90120396B-STD ガイドライン に基づいて行います。

下段のグラフは、システム内の残留炭化水素を除去するため、テスト中のレギュレーターに適用された温度上昇パターンを示しています。



300

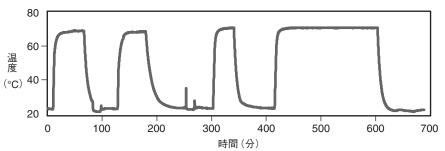
時間(分)

400

500

600

700



残留イオン濃度

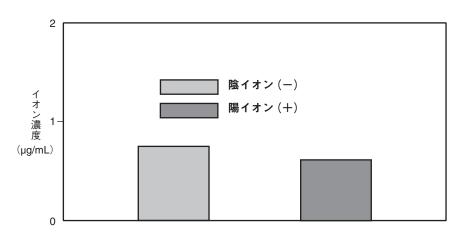
手動式レギュレーター HF シリーズは、 残留イオン・コンタミネーションが非常 に少ないことが分かります。

ASTM F1374 に基づいて、5 台のレギュレー ター(型番:SS-HFM3B-VCR4-P) のテストを行いました。

- 各レギュレーターに、超純水を充填しました。
- 充填後 24 時間を経てテスト・サンプル を抽出し、分析を行いました。

右のデータは、5台のレギュレーターの平均値を示しています。

陰イオン(ー) 陽イオン(十) フッ素化合物 リチウム 塩化物 ナトリウム 硝酸塩 アンモニア リン酸塩 カリウム 硫酸塩 マグネシウム カルシウム



実験室でのサイクル・テスト

実験室条件下(右表を参照)にて、手動式 レギュレーター HF シリーズのダイヤフ ラムのサイクル・テストを行いました。 テストの際には、5 台のレギュレーター (型番: SS-HFM3B-VCR4-P、標準ダイ ヤフラムの材質: 合金 625) を使用しま

した。

- 一次側圧力が 0.55 MPa、二次側圧力が 0.20 MPa (1 std L/min の流量にて) になるよう、各レギュレーターの校正を行いました。
- レギュレーターの一次側を窒素供給 源に、二次側を空気作動式バルブに 接続しました。
- 30 サイクル (毎分) にて、レギュレー ターを作動させました。
- レギュレーターを作動させる際、レギュレーターを通る流量は、0 ~ 30 std L/min の間で変動しました。

一定の時間間隔で、ダイヤフラムのサイクル・ライフを評価しました。外周部におけるリーク・レートが 1×10^{-9} std cm³/s 以上となった場合、故障と見なしました。すべての手動式レギュレーター HF シ

すべての手動式レキュレーター HF シリーズは、350 万サイクルを超えても、 故障することなく作動しました。

テスト・データ

数量	手動式レギュレーター HF シリーズ (5 台)
ガス	ろ過されたドライ窒素ガス
温度	20℃ の室温
一次側圧力	0.55 MPa (一定)
二次側圧力	0.20 MPa (流れがないとき) から 0 MPa (流れがあるとき)
サイクル頻度	30 サイクル (毎分)
テスト終了時の サイクル回数	> 350 万サイクル

なお、これらのテスト結果は、実際の使用における最低 サイクル数を保証するものではありません。 実験室での テストは、無限ともいえる実際の使用状況を再現することはできません。そのため、実際の使用において同じ結 果となることを保証するものではありません。

参考文献

SEMATECH SEMASPECS¹

93021510A-STD Test Method for Determination of Particle Contribution by Low-Pressure Regulators in Gas Distribution Systems

90120396B-STD Standard Test Method for Determination of Total Hydrocarbon Contribution by Gas Distribution Systems Components

ASTM Standards²

F1374 Standard Test Method for Determination of Ionic/Organic Extractables of Internal Surfaces — IC/GC/FTIR for Gas Distribution Systems Components

SEMI Standard³

E49.8 Guide for Ultra High Purity Gas Distribution Systems in Semiconductor Manufacturing Equipment

スウェージロック仕様書

超高純度工程仕様(Swagelok SC-01 仕様) (MS-06-61-EJ)

- 1. SEMATECH, Inc., 2706 Montopolis Dr., Austin, TX 78741.
- American Society for Testing and Materials, 100
 Barr Harbor Dr., West Conshohocken, PA 19428.
 Semiconductor Equipment and Materials
 International, 3801 Zanker Rd., San Jose, CA 95134.

安全な製品の選定について

安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

この日本語版技術情報は、英語版技術情報の内容を忠実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内容に英語版との相違が生じないよう、細心の注意を払っておりますが、万が一相違が生じてしまった場合には、英語版の内容が優先されますので、ご留意ください。